

# SEM・表面分析・前処理セミナー@福岡

## プログラム

09: 30～	受付
10: 00～10: 10	開会挨拶
10: 10～10: 50	新型 SEM JSM-IT210/JSM-IT710HRの紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EP技術開発部 根本 佳和
10: 50～11: 20	SEMによる粒子解析に適した試料分散方法の紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 高山 隼
11: 20～11: 50	定量マップにおける新しいバックグラウンド処理 ～疑似バックグラウンド除去機能(PBS) の紹介～ 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発部 脇元 理恵
11: 50～12: 20	昼食
12: 20～13: 00	実機・ポスター展示
13: 00～13: 30	長時間！高品質！SEM自動測定の秘訣 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 河野 林太郎
13: 30～14: 00	新型ウィンドウレス EDS検出器 ドライ SD™ Gather-Xの最新動向 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 山口 祐樹
14: 00～14: 30	失われたエネルギーに注目したら電子状態が見えてきた ～AESを利用した REELSの基礎～ 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発部 伊木田 木の実
14: 30～15: 00	XPSの波形分離でお困りの方へ ～パラメータ固定を利用した波形分離のコツ紹介～ 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発部 村谷 直紀
15: 00～15: 40	休憩 / 実機・ポスター展示
15: 40～16: 20	新型 FIB-SEM JIB-PS500iの紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 中島 雄平
16: 20～16: 50	透過電子顕微鏡を使いこなすための基礎と実践的テクニック 日本電子株式会社 EM事業ユニット EMアプリケーション部 島 政英
16: 50～17: 00	閉会挨拶
17: 00～18: 00	懇親会 / 実機・ポスター展示

\*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。